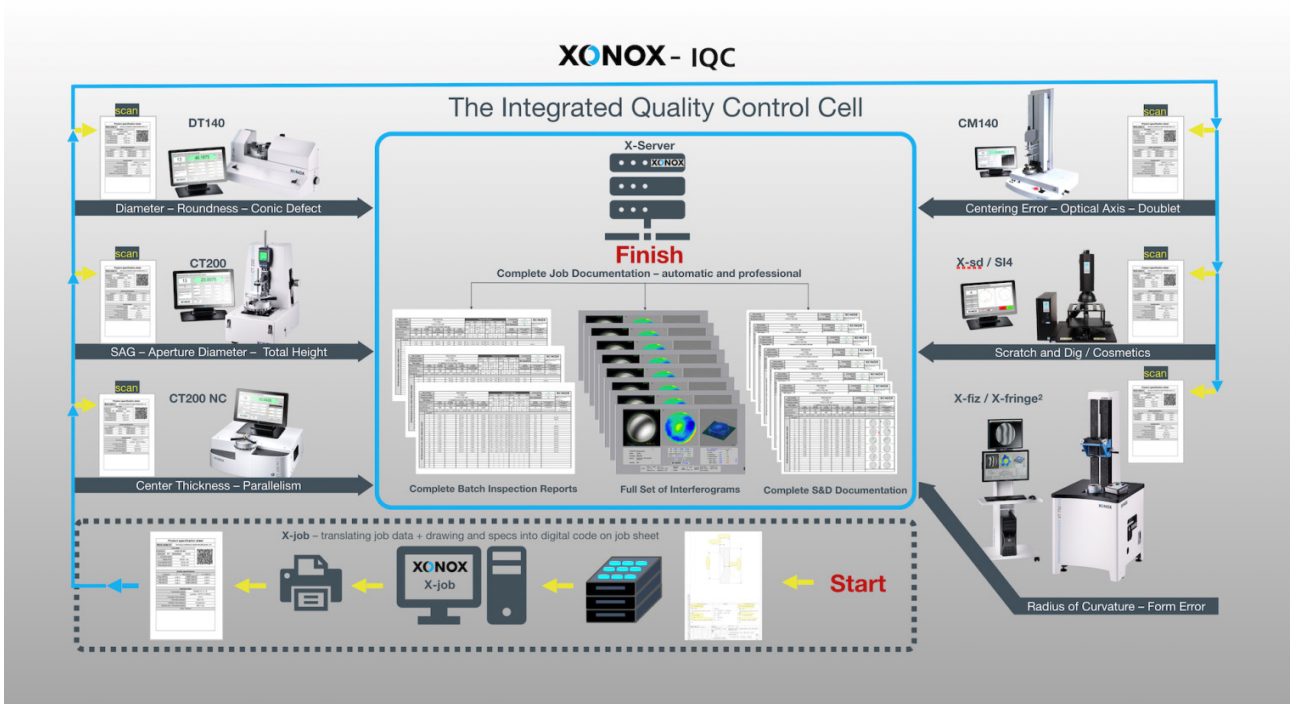


德国XONOX网络化质量控制系统

1. 通过工件规划软件，搭配完整的检测系统可对工件所有指标进行检测、存储、调用和输出。
2. 镜片图纸录入系统后输出为检测工艺单。
3. 通过扫描检测工艺单右上角的二维码，相关检测设备即可获得镜片所有参数。
4. 在每一台检测设备上进行检测后，检测结果会自动储存在系统中。
5. 通过检测，可完整的获得镜片厚度、矢高、通光口径、总高度、直径、圆度、锥度、偏心（反射或透过）外观质量、以及面型要求的所有信息。并形成完整的可输出的检测报告。
6. 每一个检测结果都会自动记录在系统中。可随时调用、打印或进行重新检测。



X-fringe2

高级条纹分析系统

1. 包括了“X-fringe ST”进行静态条纹分析，以及“X-fringe PS2”使用XONOX压电移相器“X-phase PMR”进行移相条纹分析。

2. 不同的、智能的专家和生产模式，方便波前分析和结果记录，以适应各种应用。

3. 非常智能和方便，全自动掩蔽和缩放功能与集成传输球数据库和选择工具。手动或通过XONOX二维码计量网络设置。

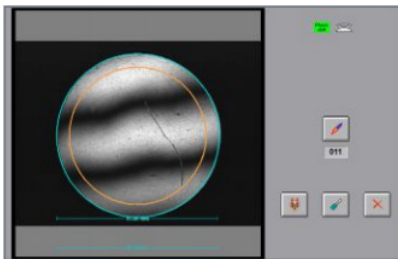
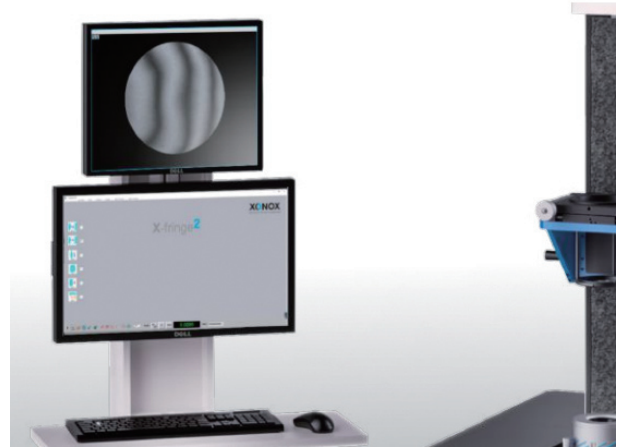
4. 自动透镜编号，创建文件和目录，以完整和全面地记录整批的测量结果。

符合ISO标准的结果表和批处理文件，具有不同颜色的规格内/规格外显示。

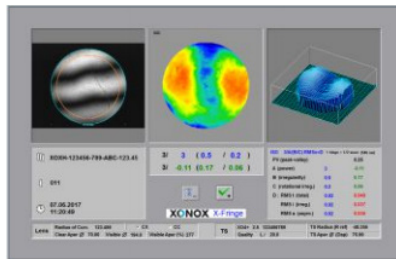
直接在软件中使用各种应用的透镜位置线性测量系统接口。

5. 精密RoC测量的自动半径测量工具

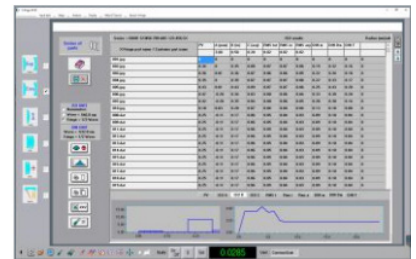
6. 历史的透射球、透射球数据和镜头保持架系统的自动识别和记录



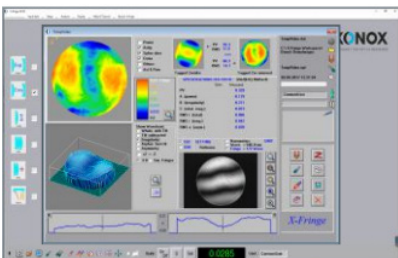
automatic mask, scaling and lens numbering



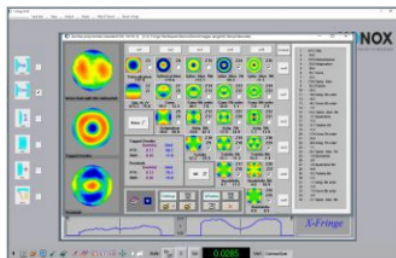
Clean and clear ISO result sheet for lens production



series documentation with results and statistics



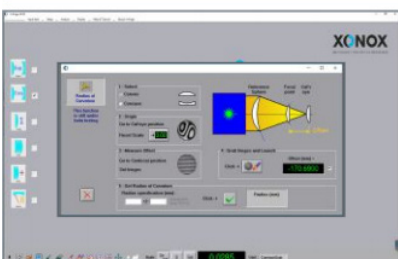
Expert Mode for comprehensive analysis



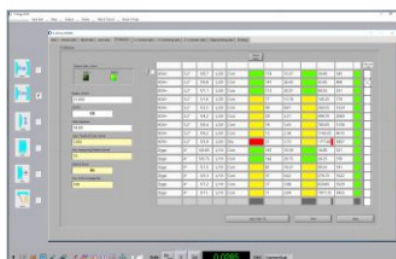
advanced analysis of Zernike polynomials



integrated interface to linear measuring system



radius of curvature measurement tool



integrated transmission sphere data base / selection



Easy Production Mode with fast QR Code setup

相移菲索型干涉仪

1. 创新的高质量菲索型干涉仪，配备高分辨率1.3MP摄像机。遥控定位，10倍光学放大。遥控定位，自动调焦。
2. 自动饱和调整的智能电子衰减器。
3. 高刚性框架和坚固的光机设计确保安装时保持精度，并随着时间的推移保持精度不会产生变化。
4. 高品质压电移相器，带倾斜式TS支架；与ZYGO型卡口和XONOX 4+连接器兼容。工业标准632.8nm 氦氖激光器。
5. 提供100毫米（4英寸）、132毫米（5.2英寸）和150毫米（6英寸）版本，5.2英寸版本与XONOX 4+系列TS目标兼容，无需光纤连接器。
6. 智能遥控器-创新的遥控器允许快速选择变焦和焦点。智能维护理念-创新的设计理念允许在几分钟内更换激光和电气部件；所有这些都不需要打开系统的敏感光学区域。激光更换不需要重新校准，并且可以在安装在测量平台内的干涉仪上来完成此过程。
7. 单接口概念-工业标准USB3.0协议，用于计算机和干涉仪之间的电缆通信，USB 3.0接口，可通过软件访问所有功能。



配置情况

激光源	632.8nm 氦氖激光器/偏振/III A-3R/2mW级输出
型号4" (100毫米)	X-fiz 100 Eco-4" (100毫米) 菲索型干涉仪 X-fiz 100 ST-4" (100 mm) 菲索型干涉仪, 带X-fringe ST条纹静态条纹分析系统 X-fiz 100 PS2-4" 相移菲索型干涉仪X-fringe2 PS相移条纹分析系统 所有X-fiz100型号的TS接口: 4" ZYGO型卡口
型号5.2" (132毫米)	X-fiz 130 Eco-5.2英寸 (100毫米) 菲索型干涉仪 X-fiz 130 ST-5.2英寸 (100毫米) 菲索型干涉仪, 带X-fringe ST条纹静态条纹分析系统 X-fiz 130 PS2-5.2 "相移菲索型干涉仪X-fringe2 PS相移条纹分析系统
型号6" (150毫米)	所有X-fiz130型号的TS接口: 5.2" XONOX 4+接口, 带4" ZYGO型卡口适配器 X-fiz 150 Eco-6" (100毫米) 菲索型干涉仪 X-fiz 150 ST-6" (100毫米) 菲索型干涉仪, 带X-fringe ST条纹静态条纹分析系统 X-fiz 150 PS2-6" 相移菲索型干涉仪X-fringe2 PS相移条纹分析系统 所有X-fiz150型号的TS接口: 6" Zygo型卡口
摄像机	1.3 Mpx, 8位单色CMOS传感器, 210 FPS, 快门最小50 μs
成像系统/光轴	10倍电动变焦和定位, 电动对焦和定位/光学轴高度: 131mm
控制面板	带旋转定位控制器的有线遥控器, 用于变焦和对焦 (饱和度自动调整)
电源	110-240 V/50-60 Hz
计算机/软件	高性能戴尔PC, 24英寸触摸屏, 19英寸实时图像屏幕 WIN10 64位, X-fringe2 PS/X-fringe ST
尺寸 (宽x高x厚)	310 x 285 x 530 (595包括移相器)
重量	约35kg
颜色	Perl浅灰色RAL 9022

XONOX 4+



4" 干涉仪用的5.2" 菲索基准镜头-提供扩展的测量范围

1. 集成30%的波前扩展使每个标准的4" 干涉仪实际上变成了一个5.2" 的系统，孔径增大了30%。
2. 现有系统无需进行机械或光学改造-只需安装在现有的4" 标准卡口中并启动与现有标准4" TS完全互换。
3. 巨大的附加值，在可见光透镜孔径和价格方面，比经典的4" TS透镜表面覆盖率高出60%。
4. 创新的F数，用于全孔径测量的更多表面的改进和无间隙覆盖。高质量的光学机械和创新的长期防尘密封组件。
5. 优秀的手工制作的参考表面。
6. “智能箱” –实用的、面向用户的安全箱和处理系统。德国XONOX 100%高品质。

镜头规格

基准镜头	F 0.7	F 0.8	F 1.1	F 1.6	F 2.5	F 4.2	F 6.4	F 9.2	F 5.9D	F ∞
孔径角	91.4°	74.5°	55.4°	36.8°	23.3°	13.7°	9.0°	6.3°	9.8°	
孔径 mm	Φ69.7	Φ79.0	Φ95.0	Φ105.4	Φ117.5	Φ123.2	Φ126.3	Φ127.1	Φ128.0	Φ129.5
半径参考表面 mm	-48.68	-65.26	-102.21	-167.10	-291.40	-516.60	-804.90	-1164.50	750.00	平面
壳体直径	Φ158mm									
外壳高度	82.7mm				58.5mm		45.5mm		58.5mm	45.5mm
参考面质量	BASE Line: λ/10 PV PRO Line: λ/20 PV PRIME Line: λ/50 (@632.8nm)									
机械连接	ZYGO compatible 4 " bayonet									

VT 750

垂直干涉仪系统

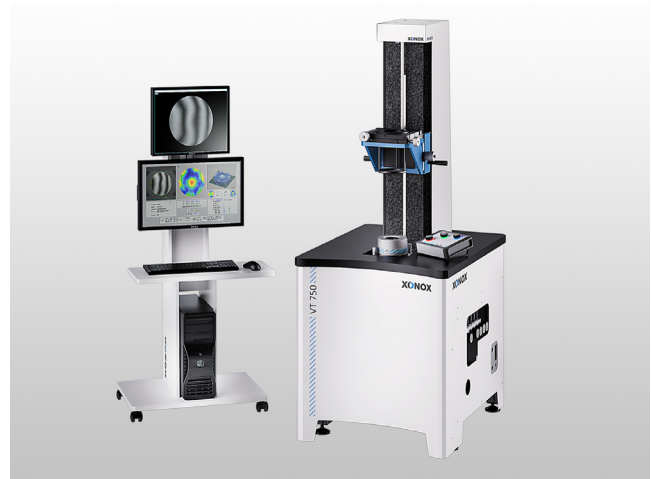
1. 生产、质量检验和计量实验室环境用精密干涉塔。天然花岗岩柱，具有极其平坦和精确的导向面，便于使用，并能非常精确地测量光学元件的曲率半径。高精度线性标度，分辨率极高，直接与条纹分析软件接口。

2. 测量台在空气轴承滑块上进行平衡和引导，以便快速、方便、准确地安装和移动，结合高精度和刚性，具有免维护设计。坚固的减震系统，可用于工业生产环境。

3. XONOX X-fiz 100 (4") 或X-fiz 130 (5.2") 高性能菲索型干涉仪，电子控制光学变焦 (1x到10x) 、聚焦和对比度调整。创新、强大、用户友好的条纹分析系统X-Fringe2，具有不同的智能模式，适合各种应用。

4. 低成本的“静态条纹分析的ST版本”到高性能的PS2相移版本。系统可配置PC桌、2块屏幕、鼠标和键盘，也可内置PC和触摸屏，以优化操作，减少生产环境中的空间需求。

5. 在“塔式”版本“B”中提供，用于集成现有的或第三方干涉仪单元，或配备ZYGO Verifire和ZYGO MX条纹分析软件的版本“Z”。



配置情况

工作范围	最小行程750mm (800mm线性刻度范围) ，最大测试直径为200mm (取决于使用的TS和零件夹持器) +微调千分尺，便于精确设置猫眼和共焦位置。
版本	_VT750 ST, XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2") ，带10倍光学变焦和静态条纹分析系统X-fringe ST _VT750 PS2, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2") ，带10倍光学变焦、相移条纹分析系统X-fringe2和压电相移器X-phase PMR _VT750 Z, 带ZYGO Verifire 4"或6"干涉仪单元和Mx/Metro前置相移条纹分析 _VT750 B “塔式”版本，用于集成现有干涉仪装置。可选配XONOX条纹分析系统X-fringe ST或X-fringe PS, X-phase PMR移相器
测量系统	带PC接口+附件SRM+的增量高精度线性测量系统，用于短半径测量 (可选) 或激光测距系统 (可选)
测量精度	每500mm高达+/-0.7 μ ，高达1纳米分辨率
尺寸 (宽x深x高) / 重量	当使用触摸屏进行条纹分析时，800 x 900 x 2100 mm (如果PC用于条纹分析，则需要额外的空间，可选择XONOX PC桌) /约500公斤
连接	110-240V/50-60HZ，压缩空气：6bar
颜色	浅灰色RAL 7035

VT 1000DL



垂直正置干涉仪系统

1. 用于生产、质量检验和计量实验室环境中，光学全孔径测试的精密垂直正置干涉仪系统。用于平面光学、球体和非球面的子孔径抛光和校正过程的优化。集成的特性和技术，使测量数据与子孔径校正的坐标系/轴完美对齐，以实现最高的校正质量和效率。

3. 天然花岗岩柱，具有非常平坦和精确的导向面，便于使用和非常精确地测量光学元件的曲率半径。高精度线性标度，分辨率高，直接与条纹分析软件接口。

4. 测量台在空气轴承滑块上进行平衡和引导，以便快速、方便、准确地设置和移动。全封闭测量区域，采用创新的门系统，可进行精确、可靠、无干扰的测量。坚固的减震系统，用于工业生产环境。

5. XONOX X-fiz 100 (4") 或 X-fiz 130 (5.2") 高性能菲索型干涉仪，电子控制光学变焦 (1x 到 10x)、聚焦和对比度。创新、强大、用户友好的条纹分析系统 X-fringe2，具有不同的智能模式，适合各种应用。

6. 从具有静态条纹分析的低成本“ST”版本到高性能“PS2”相移版本进行选择。另外，在“塔式”版本“B”中提供，用于集成现有的或第三方干涉仪单元，或配备 ZYGO Verifire 和 ZYGO MX 条纹分析软件的版本“Z”。

配置情况

工作范围	最小行程1000 mm，最大测试直径为250 mm（取决于使用的TS和零件夹持器）+微调千分尺，便于精确设置猫眼和共焦位置
版本	<p>_ VT1000 DL ST, XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦和静态条纹分析系统X-fringe ST</p> <p>_VT1000 DL PS2, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦、相移条纹分析系统X-fringe2和压电相移器X-phase PMR</p> <p>_VT1000 DL Z, 带ZYGO Verifire 4 “或6” 干涉仪单元和Mx/Metro前置相移条纹分析</p> <p>_VT1000 DL B “塔式” 版本，用于集成现有干涉仪装置。可选配XONOX条纹分析系统X-fringe ST或X-fringe PS, X-phase PMR移相器</p> <p>所有型号可根据要求配备1或2个测量滑轨和CGH多轴治具</p>
测量系统	带PC接口，并有温度膨胀补偿功能的增量高精度线性测量系统（标准）/交替激光测距系统（可选）
测量精度	线性滑尺：20° C时每500mm高达 $\pm 0.7 \mu$ ，高达1纳米分辨率（标准 0.5μ m）
尺寸（宽x深x高）/重量	1200 x 900 x 2800 mm（如果PC用于条纹分析，则需要额外的空间，可选择XONOX PC桌）/约950公斤
连接	110–240 V/50–60 HZ，压缩空气：6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

VT 1200

垂直干涉仪系统

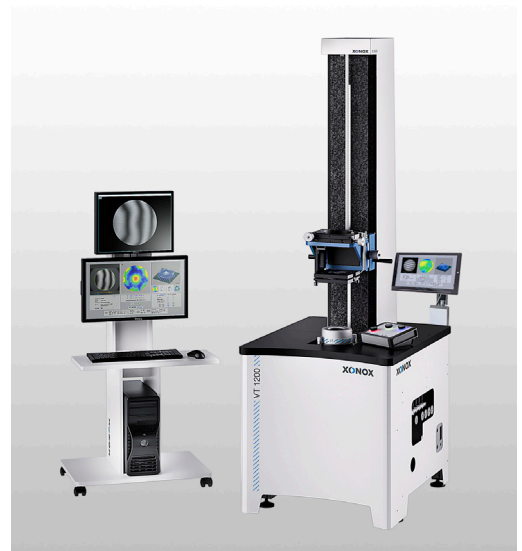
1. 生产、质量检验和计量实验室环境用精密干涉塔。半径高达140mm的天然花岗岩柱的超大测量范围，具有极其平坦和精确的导向面，便于使用，并能非常精确地测量光学元件的曲率半径。

2. 高精度线性标度，分辨率极高，直接与条纹分析软件接口。测量台在空气轴承滑块上进行平衡和引导，以便快速、方便、准确地安装和移动。占地面积小，并结合高精度和刚性的免维护设计。坚固的减震系统，非常适用于工业生产环境。

3. XONOX X-fiz 100 (4") 或X-fiz 130 (5.2") 高性能菲索干涉仪，电子控制光学变焦 (1x至10x)、聚焦和对比度。创新、强大、用户友好的条纹分析系统X-fringe2，具有不同的智能模式，适合各种应用。

4. 从具有静态条纹分析的低成本“ST”版本到高性能“PS2”相移版本系统可配置PC桌、2块屏幕、鼠标和键盘，也可内置PC和触摸屏，以优化操作，减少生产环境中的空间需求。

5. 在“塔式”版本“B”中提供，用于集成现有的或第三方干涉仪单元，或配备ZYGO Verifire和ZYGO MX条纹分析软件的版本“Z”。



配置情况

工作范围	最小行程1200 mm (1400 mm线性刻度范围)，最大测试直径为200 mm (取决于使用的TS和零件夹持器)
版本	_VT1200 ST, XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦和静态条纹分析系统X-fringe ST _VT1200 PS2, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦、相移条纹分析系统X-fringe2和压电相移器X-phase PMR _VT1200 Z, 带ZYGO Verifire 4 “或6”干涉仪单元和Mx/Metro前置相移条纹分析 _VT1200 B “塔式”版本，用于集成现有干涉仪装置。可选配XONOX条纹分析系统X-fringe ST或X-fringe PS, X-phase PMR移相器
测量系统	带PC接口+附件SRM+的增量高精度线性测量系统，用于短半径测量 (可选) 或激光测距系统 (可选)
测量精度	每500 mm高达 $\pm 0.7 \mu$ ，高达1纳米分辨率
尺寸 (宽x深x高) / 重量	当使用触摸屏进行条纹分析时，800 x 900 x 2650 mm (如果PC用于条纹分析，则需要额外的空间，可选择XONOX PC桌) /约650公斤
连接	110-240 V/50-60 HZ，压缩空气：6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

HS 1200 light

水平干涉仪系统

1. 实验室、研发、光学车间和质量检验用精密水平干涉仪系统。

2. 可以安装在客户现有的光学防震台上。

3. 精密空气轴承导向直线测量滑轨，移动迅速、方便、准确。

4. 天然花岗岩柱，具有非常平坦和精确的导向面，用于光学元件和精密线性装置的高精度曲率半径测量。

5. 具有最高分辨率和直接软件接口的高精度增量线性比例尺。

6. XONOX X-fiz 100 (4") 或 X-fiz 130 (5.2") 高性能菲索型干涉仪，电子控制光学变焦 (1x到10x)、聚焦和对比度。创新、强大、用户友好的条纹分析系统X-fringe2，具有不同的智能模式，适合各种应用。

7. 具有静态条纹分析的低成本“ST”版本到高性能“PS2”相移版本。



配置情况

工作范围	最小行程1200 mm (线性刻度范围1400 mm)，最大试验直径200 mm (取决于使用的TS和零件支架)
版本	_ HS1200 lightST, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦和静态条纹分析系统X-fringe ST _ HS1200 light PS2, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦、相移条纹分析系统X-fringe2和压电相移器X-phase PMR
测量系统	带PC接口，并有温度膨胀补偿功能的增量高精度线性测量系统 (标准) /交替激光测距系统 (可选)。蜂窝光学台可选柱可与用户提供的标准隔振光学台配套使用。
测量精度	线性滑尺: 20°C时每500mm高达 $\pm 0.7 \mu\text{m}$ ，高达1纳米分辨率 (标准 $0.5 \mu\text{m}$)
尺寸 (宽x深x高) / 重量	当使用触摸屏进行条纹分析时，为2500 x 1200 x 1200 mm (如果PC用于条纹分析，则需要额外的空间，可选择XONOX PC桌) /约900 kg
连接	110-240 V/50-60 HZ，压缩空气: 6 bar
颜色	天然花岗岩

HS 1200

水平干涉仪系统

1. 实验室、研发、光学车间和质量检验用精密水平干涉仪系统。全功能光学工作台与嵌入光学工作台的高精度直线轴相结合。减振调平系统在研发和工业环境中的完美应用，精密空气轴承导向直线测量滑轨，移动迅速、方便、准确。天然花岗岩柱，具有非常平坦和精确的导向面，用于光学元件和精密线性装置的高精度曲率半径测量，具有最高分辨率和直接软件接口的高精度增量线性比例尺。



2. XONOX X-fiz 100 (4") 或X-fiz 130 (5.2") 高性能菲索型干涉仪，电子控制光学变焦 (1x到10x)、聚焦和对比度。

3. 创新、强大、用户友好的条纹分析系统X-fringe2，具有不同的智能模式，适合各种应用。具有静态条纹分析的低成本“ST”版本到高性能“PS2”相移版本进行选择。“塔式”版本“B”中提供，用于集成现有的或第三方干涉仪单元，或配备ZYGO Verifire和ZYGO MX条纹分析软件的版本“Z”。

配置情况

工作范围	最小行程为1200毫米 (线性刻度范围为1400毫米)，最大测试直径为200毫米 (取决于使用的TS和零件夹持器)+微调千分尺，方便精确地设置猫眼和共焦位置
版本	_ HS1200 ST, XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦和静态条纹分析系统X-fringe ST _ HS1200 PS2, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2")，带10倍光学变焦、相移条纹分析系统X-fringe2和压电相移器X-phase PMR _ HS1200 Z, 带ZYGO Verifire 4 “或6” 干涉仪单元和Mx/Metro前置相移条纹分析 _ HS1200 B “塔式” 版本，用于集成现有干涉仪装置。可选配XONOX条纹分析系统X-fringe ST或X-fringe PS, X-phase PMR移相器
测量系统	带PC接口，并有温度膨胀补偿功能的增量高精度线性测量系统 (标准)/交替激光测距系统 (可选)。
测量精度	线性滑尺: 20°C时每500mm高达 $\pm 0.7 \mu\text{m}$ ，高达1纳米分辨率 (标准 $0.5 \mu\text{m}$)
尺寸 (宽x深x高)/重量	2150 x 900 x 1100mm，不带干涉仪和附件 (如果PC用于条纹分析，则需要额外的空间，XONOX PC台可选)/约600kg
连接	110-240 V/50-60 HZ，压缩空气: 6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

PI 500

平面干涉仪系统

1. 测量平面光学元件的精密垂直干涉仪，带有空气轴承的零件治具，便于在不同位置移动，用于边缘分析的较重工件。尖端倾斜装置，便于调整边缘，集成在可移动部件支架中。高平面度天然花岗岩精密减振测量台，不松边，可在不同位置进行舒适分析。为测量不同厚度工件，可调干涉仪高度到最佳位置。

2. XONOX X-fiz 100 (4") 或X-fiz 130 (5.2") 高性能菲索型干涉仪，电子控制光学变焦 (1x到10x)、聚焦和对比度。创新、强大、用户友好的条纹分析系统X-fringe2，具有不同的智能模式，适合各种应用。具有静态条纹分析的低成本“ST”版本到高性能“PS2”相移版本进行选择。

3. 系统可配置PC桌、双屏幕、鼠标和键盘，也可内置PC和触摸屏，以优化操作，减少生产环境中的空间需求

另外，在“塔式”版本“B”中提供，用于集成现有的或第三方干涉仪单元，或配备ZYGO Verifire和ZYGO MX条纹分析软件的版本“Z”。



配置情况

工作范围	最大工件直径500 mm
版本	_ PI500 ST, XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2") /X-fiz 100-6 (6") , 带10倍光学变焦和静态条纹分析系统X-fringe ST _ PI500 PS2, 带XONOX X-fiz 100 (4") /X-fiz 130 (5.2") /X-fiz 100-6 (6") , 带10倍光学变焦、相移条纹分析系统X-fringe2和压电相移器X-phase PMR _ PI500 Z, 带ZYGO Verifire 4"或6"干涉仪单元和ZYGO Mx前置相移条纹分析 _ PI500 B “平台式”版本, 用于集成现有干涉仪装置。可选配XONOX条纹分析系统X-fringe ST或X-fringe PS, X-phase PMR移相器
测量系统	带PC接口+附件SRM+的增量高精度线性测量系统, 用于短半径测量 (可选) 或激光测距系统 (可选)
测量精度	每500mm高达 $\pm 0.7 \mu$, 高达1纳米分辨率
尺寸 (宽x深x高) / 重量	当使用触摸屏进行条纹分析时, 为800 x 900 x 2200 mm (如果PC用于条纹分析, 则需要额外的空间, 可选择XONOX PC桌) /约600 kg
连接	110-240 V/50-60 HZ, 压缩空气: 6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

CT 200 G2

中心厚度检测仪（接触式）第二代



第二代——现配备触摸屏界面电子控制测量周期

由软件控制的自动运动循环编辑和配置，与特定作业相关联（需要X-ct软件包）。

1. 在生产和质量检验环境中，用于研磨，镀膜和抛光光学元件的高精度和耐用的中心厚度测量系统，为长期可靠和经济效率的运行而设计。除了CT测量外，还支持凹陷深度、表面孔径直径、透镜总高度和材料去除的测量。

2. 镜片自动对中，采用创新的精密三爪卡盘系统，通过同时触碰工件上下两侧的探针，自动气动驱动实现CT的直接测量。简单、快速、安全地安装和装载工件，经许多独立方证明，即使是最敏感的抛光和镀膜光学元件，也能避免表面损伤的危险，保证严格的外观要求。

3. 测量范围从直径8毫米到200毫米。为方便高效测量，连接了脚踏开关。可选的软件和控制器包，“X-ct”与独创的“XONOX e-box”硬件提供额外的测量模式、自动文档创建和测量结果的数据记录。

配置情况

工作范围	不同可调位置上，测量仪表为50 mm行程
直径范围	8–200 mm
测量系统	0.5 μ 分辨率数字精密测量仪
测量精度	分辨率：0.0005mm精度：≤ 0.002 mm重复性：0.001 mm
尺寸（宽x深x高）/重量	460 x 300 x 650 mm（带X-ct 控制软件的XONOX e-box所需的额外空间）/约30kg
连接	110–240 V/50–60 HZ，压缩空气：6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

CT 200NC G2

非接触式中心厚度检测仪第二代



第二代-现在有了改进的、连续的测量信号、更高的精度和更快的测量速度。

1. 高精度、易于使用的非接触式系统，用于测量生产和质量检验环境中光学元件的厚度。用于快速、可靠和高精度厚度测量的集成式干涉传感器。单元素和双元素的测量，镜片自动对中，采用创新的精密三爪卡盘系统，只允许测量单侧进入的元件。

2. 理想的测试透镜-甚至安装在支架上-在抛光操作中具有苛刻的CT公差。符合人体工程学的定位镜头架提供安全、方便、快速的工件装载和安装，触摸屏位置方便，操作简单快捷。从微米光学尺寸到直径200mm的大测量范围，广泛的集成玻璃数据库提供对索引数据的随时访问。

2. 支持到CT200的连接，允许自动分析未知索引值。配备功能丰富的软件和控制器包、“X-ctNC”和触摸屏界面。

配置情况

工作范围	最大光学厚度85 mm，最大零件厚度取决于材料指数
直径范围	从微米光学尺寸到200毫米
测量系统	基于光学干涉仪的精密同轴测量系统
测量精度	重复性: 0.5 μm/精度: +/-1 μm (取决于透镜中心度/折射率不确定度)
尺寸(宽x深x高)/重量	530 x 490 x 540 mm (加上仪表顶部的触摸屏高度)/约25 kg
连接	110-240 V/50-60 HZ, 压缩空气: 6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

DT 140 G2

直径测量系统二代



二代-现配备触摸屏界面电子控制测量周期。软件控制的编辑和配置自动运动循环，链接到特定作业（需要X-ct软件包）。

1. 高精度、易用的光学元件直径、圆度和锥度测量系统。为长期可靠和经济效率的运行而设计，除了初级直径外，还支持二级直径和圆度的测量。
2. 镜片自动对中，采用创新的精密三爪卡盘系统。通过自动气动触碰工件边缘的探针实现直径的直接测量探头接触高度可调，与台阶和其他边缘特征兼容。
3. 为安全、快速、方便地安装和装载工件而优化。多次证明，即使是非常薄的刀口和敏感部件，也绝对无风险/无损坏。测量范围大，从直径8mm到140mm，连接脚踏开关，方便高效地测量。配有软件和控制包，X-dt与独创的”XONOX e-box”提供额外的测量模式、自动文档创建和测量结果的数据记录。

配置情况

工作范围	不同可调位置上，测量仪表为50 mm行程
直径范围	8–140 mm
测量系统	0.5 μ 分辨率数字精密测量仪
测量精度	分辨率：0.0005 mm精度：≤ 0.002 mm重复性：0.001 mm
尺寸（宽x深x高）/重量	650x 300x350 mm（带X-dt控制软件的XONOX e-box所需额外空间）/约30kg
连接	110–240 V/50–60 HZ，压缩空气：6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

CM 140 G2

中心误差测量系统二代



二代-现在具有自动z轴定位加上软件支持的电子运动和真空控制，链接到具体的工作。附加HR屏幕，显示实际旋转状态、led和真空度。

1. 用于在生产、质量检验或计量实验室环境中确定透镜元件对中误差的测量，精确且易于操作的非接触测量系统高精度自准直仪和二级准直仪辅助测量。对历史记录设置的软件调用有助于高效地使用重复作业。

2. 透镜中心可以在透射或反射中测量。独特的，高度可调的卡盘，自动调整不同直径的镜片中心，正确定位摩擦轮，有效装载和操作，无需更换或调整V形挡块，即可快速方便地设置透镜架。

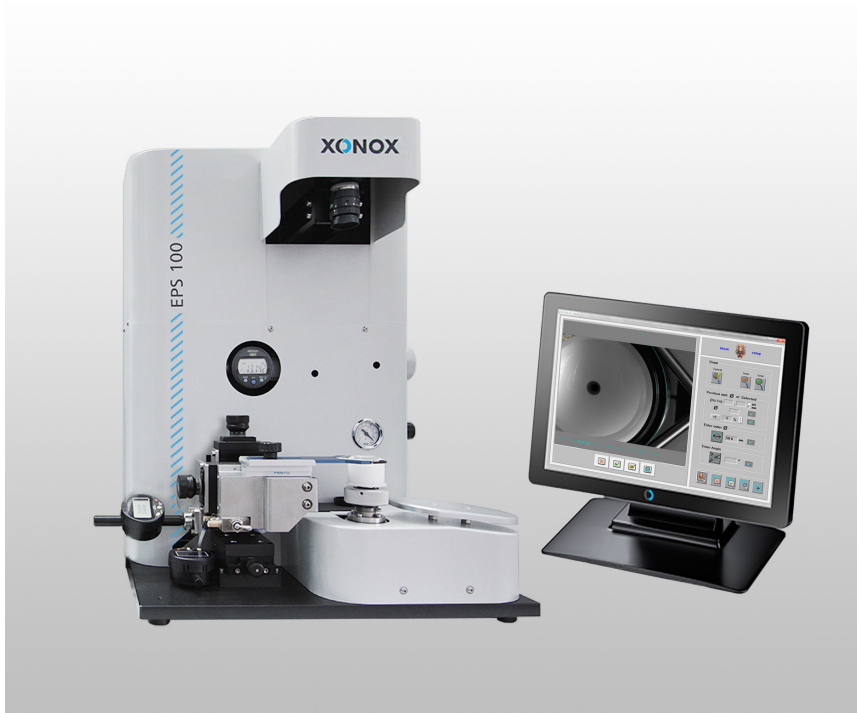
3. 常用功能位置方便，便于访问和直接控制Z轴高度、真空度、速度、十字线显示，测量范围大。配有广泛的软件和控制包，各种模式的“X-cm”和全系列测量结果的自动记录。

配置情况

工作范围	750 mm Z轴行程
直径范围	8-140mm
测量系统	高精度自准直仪和辅助准直仪
尺寸(宽x深x高)/重量	590x 570x1300 mm (X-dia PC所需的额外空间)/约35 kg
连接	110-240 V/50-60 HZ, 压缩空气: 6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

EPS 100

边缘和掩膜喷漆系统



1. 光学元件边缘和精密表面掩模的安全、简便、高效的涂漆和上漆系统。通过监视器和高倍率的实时视频系统观察涂漆区域，用软件和精密量具精确调整涂漆孔径。使用可精确调节的气动V形块调整镜头位置和方便重新装载镜头，涂漆后直接测量掩膜直径的质量控制。

2. 工件主轴转速可无级变速，树脂夹头上透镜固定的真空度可无极调整。真空开/关踏板和主轴旋转开/关，即使在大容量喷漆时也能方便有效地使用。可选择通过标准相机软件或综合软件工具XONOX “X-paint” 进行操作，具有各种和多种掩膜的高级功能。

配置情况

工作范围	最大工件直径100 mm
主轴转速	0-300转/分，无级变速
真空	0-0.6 bar，无极调整
尺寸（宽x深x高）	500 x 300 x 700 mm（PC和显示器所需的额外空间）
重量	约30公斤
连接	110-240 V/50-60 HZ，压缩空气：6 bar
颜色	浅灰色RAL 7035

XONOX6"-8"

用于6英寸干涉仪的8英寸（203.2mm）扩束系统-提供扩大的测量范围



1. 它的设计完全兼容商用6英寸菲索干涉仪。
2. 光束扩展器和匹配的“8英寸20 PV质量的平面基准镜”非常适合于评估大口径光学系统的透射波前误差或表面形状误差。
3. 附加衍射全息图或零透镜可以用来测试各种形状的大口径光学器件。
4. 可选专用夹具，便于在水平设置中使用扩束器和平面基准镜。夹具设计用于支撑组件的重量，而不限制沿光轴的运动。
5. 精密调整系统，便于对准光轴。

镜头规格

8英寸扩束镜	
输入扩束直径	6英寸 (152.4mm)
输入安装	ZYGO兼容的6"卡口
输出扩束直径	8英寸 (203.2mm)
输出安装	XONOX8英寸卡口
总长度	276mm
机械直径	239mm
重量	8kg

8英寸平面基准镜	
孔径	8英寸
安装	8英寸XONOX卡口
输出扩束直径	8英寸
壳体直径	236mm
总长度	65mm (安装时高度增加45mm)
最终反射面精度	$\lambda/20$
重量	5kg

CT300 G2

中心厚度检测仪（接触式）第二代



1. 第二代——现配备触摸屏界面电子控制测量周期

2. 由软件控制的自动运动循环编辑和配置，与特定作业相关联（需要X-ct软件包）。

3. 在生产和质量检验环境中，用于研磨，镀膜和抛光光学元件的高精度和耐用的中心厚度测量系统，为长期可靠和经济效率的运行而设计。除了CT测量外，还支持凹陷深度、表面孔径直径、透镜总高度和材料去除的测量。

4. 镜片自动对中，采用创新的精密三爪卡盘系统，通过同时触碰工件上下两侧的探针，自动气动驱动实现CT的直接测量。简单、快速、安全地安装和装载工件，经许多独立方证明，即使是最敏感的抛光和镀膜光学元件，也能避免表面损伤的危险，保证严格的外观要求。

5. 测量范围从直径12毫米到300毫米。为方便高效测量，连接了脚踏开关。可选的软件和控制器包，“X-ct”与独创的“XONOX e-box”硬件提供额外的测量模式、自动文档创建和测量结果的数据记录。

配置情况

工作范围	不同可调位置上，测量仪表为50 mm行程
直径范围	12-300mm
测量系统	0.5 μ 分辨率数字精密测量仪
测量精度	分辨率：0.5 μ m 20° C时精度：≤ 3 μ m重复性：1 μ m
尺寸（宽x深x高）/重量	460 x 360 x 650 mm（带X-ct 控制软件的XONOX e-box所需的额外空间）/约30kg
连接	110-240V/50-60HZ，压缩空气：6bar
颜色	浅灰色RAL 7035